

# フェムト秒レーザー超微細加工システム

株式会社三啓製

設置場所： バイオナノテクノロジーセンター（片柳研究所棟 6階）



マイクロ光造形法に用いられる装置です。マイクロカンチレバーやマイクロ流路などのマイクロデバイスの製作に使われます。この装置は、新規のマイクロデバイスの開発やタンパク質相互作用の研究、超小型バイオセンサーの製作への応用が可能です。

## 装置の特長

- フェムト秒レーザーによる200nm以下の微細加工が可能
- 3次元光造形、細胞加工、流路加工などに利用可能

## 主な仕様

- 波長 750nm±10nm
- 外部から調整を加えることなく波長シフトが可能で、パルス幅100フェムト秒以内、最大出力0.7W
- 2軸ガルバノミラーによる高速走査（XY方向）応答周波数2kHz以上
- ピエゾ素子による精密位置決め（Z軸）500μmストローク、分解能3nm
- 小型レーザーヘッド 23×14×5インチ、59×35×12cm
- 対物レンズ 100倍、NA1.3